

■募集情報

募集番号	2025-9
部署名	ネットワーク研究所フォトニック ICT 研究センター
インターンシップ課題名	光・電波集積デバイスの半導体プロセス加工と最適化
インターンシップ内容の概要	当機構が研究開発を進めている光・電波集積デバイスの主要部材となる光導波路構造を用いた光ゲインデバイス（半導体光増幅器）に関する微細加工プロセスとその評価方法の実習を行う。本インターンシップではクリーンルーム内での半導体微細加工装置を用いた作業を実体験し、光ゲインデバイスの作製とその電気・光学的評価を実施する。
課題に関する問い合わせ先	先端 ICT デバイスラボ 山本直克 042-327-6982
応募条件	<ul style="list-style-type: none"> ・対象：高専、大学、大学院 ・大学3年生以上
実施場所	小金井本部
実施期間	2026年1月6日～2月20日の間の期間
受入可能最大人数	3名
選考課題	
備考	